# (LaAlO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>(Sr<sub>2</sub>AlTaO<sub>6</sub>)<sub>7</sub> 単結晶基板上における BaHfO<sub>3</sub> 人工ピンを添加した SmBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>3</sub> 薄膜の超伝導特性

Superconducting properties of BaHfO<sub>3</sub> doped SmBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> epitaxial films on (LaAlO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>(Sr<sub>2</sub>AlTaO<sub>6</sub>)<sub>7</sub> single crystalline substrates

渡邊 俊哉, 三浦 峻, 一野 祐亮, 吉田 隆(名大)

WATANABE Shunya, MIURA SHUN, ICHINO Yusuke, YOSHIDA Yutaka (Nagoya Univ.) E-mail: watanabe-syunya13@ees.nagoya-u.ac.jp

## 1. はじめに

 $SmBa_2Cu_3O_y$  (SmBCO) 超伝導薄膜の磁場中超伝導特性の向上手段として基板の選択や  $BaMO_3$ (BMO: M=Zr, Sn, Hf)ナノロッドの導入などがある。 $BaHfO_3$ (BHO)は、厚膜時の臨界電流密度( $J_c$ )の低下が少なく、低温において強いピンニン グ 力 を 持 つ こ と が 報 告 さ れ て い る [1]。  $REBa_2Cu_3O_y$ (REBCO)薄膜の $J_c$ は、REBCO の結晶配向性に依存するため、SZZZYYと基板の構造相転移などの影響を大きく受ける。そこで本研究では、高い配向性かつ磁場中で優れた超伝導特性を持つ SmBCO 薄膜の作製を行うために、基板には成膜後の降温時に構造相転移が発生しない( $LaAlO_3$ ) $_6$ ( $Sr_2AlTaO_6$ ) $_7$  (LSAT) (100)単結晶を使用し、広い温度範囲でエピタキシャル薄膜の作製が可能な低温成膜法(LTG 法)を用いた。さらに、SHO 人工ピンの導入とその添加量の制御を行い、磁場中超伝導特性についての評価を行った。

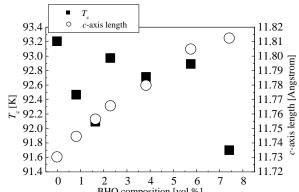
## 2. 成膜条件と評価方法

KrF エキシマレーザー(波長 248 nm)を用いた PLD 法によって、LSAT (100)単結晶基板上に BHO-SmBCO 薄膜を作製した。BHO-SmBCO 薄膜の作製に用いた LTG 法は以下に述べる。LSAT 基板上に SmBCO 薄膜がエピタキシャル成長かっ c 軸配向する基板温度  $T_s^{\text{seed}}$  (910  $^{\circ}$ C)で seed layer を作製し、その後  $T_s^{\text{seed}}$  より低い基板温度  $T_s^{\text{upper}}$  (860  $^{\circ}$ C)により upper layer の作製を行った。BHO 添加量は 0  $^{\circ}$  7.4 vol.%、レーザーエネルギー密度は 1.7  $J/\text{cm}^2$ 、繰り返し周波数は 10 Hz、成膜酸素分圧は 400 mTorr とし、膜厚は 350~400 nm とした。作製した薄膜の表面形状は原子間顕微鏡(AFM)、配向性は X線回折法、磁場中の超伝導特性は直流四端子法を用いて評価した。また、ブロムメタノールエッチングした BHO-SmBCO 薄膜表面を AFM 観測することにより BHO ナノロッド数密度を見積もった。

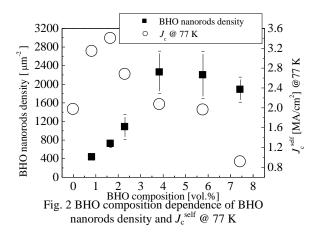
## 3. 実験結果と考察

BHO 添加量を変化させ SmBCO 薄膜を作製し、超伝導特 性を評価したところ、BHO 添加は SmBCO 薄膜の c 軸長と超 伝導特性に大きく影響を与えることが分かった。Fig. 1にBHO 添加量に対する超伝導転移温度(Tc)と BHO-SmBCO 薄膜の c 軸長を示す。図より、BHO-SmBCO 薄膜に比べて pure-SmBCO 薄膜は T<sub>c</sub> (93.2 K)が最も高く、BHO 添加量が 7.4 vol.%のBHO-SmBCO 薄膜のT<sub>c</sub> (91.7 K)は他の薄膜に比 べて  $0.4 \sim 1.5$  K 低下した。また、BHO-SmBCO 薄膜の c 軸長 はBHO添加量に比例して伸びた。BHOナノロッドが形成され たことで、SmBCO 薄膜に歪が発生し、導電面( $CuO_2$ 面)のキャ リア密度が低くなり $T_c$ が低くなったと考えられる。Fig. 2にBHO 添加量に対する BHO ナノロッド数密度と 77 K における自己 磁場中の臨界電流密度(Jcself)を示す。BHO ナノロッドの数密 度は、BHO 添加量が 3.8 vol.%までは単調増加しているが、 それ以上の添加量ではエラーバーの範囲内でほぼ一定の値 を取った。この結果より、3.8 vol.%以上では添加量の増加と 共にナノロッドの直径が大きくなっていると考えられる。過飽和 度が高いほど BHO の核生成頻度は高くなるため、添加量が

増加すると BHO ナノロッドはより高密度に形成される。しかし、ある一定値以上に過飽和度が高い場合、BHO 核の間隔が飛来した BHO 構成元素の表面拡散距離と同程度になる。これにより、新たに核が形成されるよりも核に取り込まれる BHO 分子の数が増え、ナノロッドが太くなると推察される。また、 $J_c^{\rm self}$ は BHO 添加量に対して上に凸の傾向にあり、BHO 添加量が 1.7 vol.%のとき極大値(3.4 MA/cm²)を取った。磁場中  $J_c$  特性を評価した結果、B=1 T (@ 77 K, B // c)におけるpure-SmBCO 薄膜の  $J_c$ は、0.3 MA/cm² であったが、BHO 添加量が 0.8 vol.%のとき 1.0 MA/cm²、1.7 vol.%のとき 1.1 MA/cm²、2.3vol.%のとき 0.69 MA/cm² と磁場中  $J_c$  が向上することが確認された。



BHO composition [vol.%] Fig. 1 BHO composition dependence of  $T_c$  and c-axis length for SmBCO films on LSAT



#### 謝辞

本研究の一部は、科学研究費補助金(19676005, 20686065, 23226014 及び 25289358) からの助成を受けて実施したものである。

#### 参考文献

 H. Tobita, et al.: Supercond. Sci. Technol, 25 (2012) 062002